

産業技術総合研究所 平成 28 年度 研究評価委員会（エレクトロニクス・製造領域）  
議事要旨

1. 日時：平成 29 年 3 月 28 日（火）10:00—17:30
2. 場所：産業技術総合研究所 つくばセンター第一事業所 ネットワーク会議室
3. 議事
  - (1) 開会挨拶
  - (2) 委員等紹介・資料確認
  - (3) 各項目についての説明（質疑含む）（議事進行：前川 禎通 評価委員長）
  - (4) 現場見学会
  - (5) 総合討論・評価委員討議・講評（議事進行：前川 禎通 評価委員長）
  - (6) 閉会挨拶
4. 議事概要
  - (1) 評価対象項目の説明と質疑応答  
資料 4、5 に基づき、領域の概要と研究開発マネジメント、「橋渡し」のための研究開発（1）「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）、（2）「橋渡し」研究前期における研究開発、（3）「橋渡し」研究後期における研究開発についての説明と質疑が行われた。
  - (2) 現場見学会  
エレクトロニクス・製造領域による「先進コーティング技術」、「光センシング技術」の説明が行われた。
  - (3) 総合討論  
説明全般について総合討論が行われた。
  - (4) 講評  
前川評価委員長より、評価対象項目に対する講評が行われた。
5. 評価委員（敬称略、委員五十音順）

前川 禎通	日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター長（評価委員長）
神永 晋	SK グローバルアドバイザーズ株式会社 代表取締役
久保 佳実	物質・材料研究機構 ナノ材料科学環境拠点 運営総括室長
小浦 節子	千葉工業大学 工学部 応用化学科 教授
渡辺 美代子	科学技術振興機構 副理事

## 6. 配布資料

資料 1 : 議事次第

資料 2 : 出席予定者

資料 3 : 座席表

資料 4 : 評価資料 (主な業務実績等)

資料 5 : 説明資料

別添 1 : 平成 28 年度計画 (抜粋)

別添 2 : 評価項目及び評価方法

別添 3 : 産総研評価情報システム利用ガイド (評価委員のみ)

別添 4 : 評価コメント記入用紙 (評価委員のみ)